

ЭФФЕКТ ХОЛЛА НА ПОВЕРХНОСТИ ГЕРМАНИЯ ПРИ РАСКОЛЕ КРИСТАЛЛОВ В ЖИДКОМ ГЕЛИИ

Б.М.Вул, Э.И.Заваричкал

При расколе кристаллов германия в жидким гелии свежеобразованная поверхность захватывает на оборванные связи электроны из приповерхностного слоя германия, оставляя дырки в валентной зоне. Измерения эффекта Холла показали, что концентрация свободных дырок в приповерхностном слое и, соответственно, концентрация электронов на поверхности примерно равны $\sim 10^{13}$ см $^{-2}$. Подвижность дырок $\mu \sim 300$ см 2 /В·сек. Общая физическая картина явлений та же, что и на поверхности сращивания бикристаллов германия.

В предыдущей статье мы сообщили о некоторых результатах исследования при $T = 4,2\text{K}$ поверхностной электропроводности германия после раскола кристаллов в жидким гелием [1]. В настоящей работе представлены результаты измерений эффекта Холла при тех же условиях эксперимента, что и в работе [1].

Измерения показали, что независимо от типа проводимости исходных кристаллов и концентрации в них примесей, поверхностная электропроводность в германии обязана движению дырок. Измерения ЭДС Холла были проведены на 14 образцах Ge *n*- и *p*-типа с различной концентрацией доноров и акцепторов в интервале от 10^{14} до $3 \cdot 10^{15}$ см $^{-3}$. Результаты измерения коэффициента Холла R_s для пяти из этих образцов приведены на рис. 1; для остальных образцов результаты измерений аналогичны приведенным и содержатся в том же интервале R_s . Наблюдаемые значения R_s не зависят от свойств образцов до скола.

Результаты измерений холловской подвижности $\mu = R_s \sigma_s$ для различных образцов приведены на рис. 2. Все эти данные относятся к образцам, подвергнутым после раскола промежуточному подогреву при $T_n \approx 40\text{K}$.

Из данных, представленных на рис. 1, следует, что коэффициент Холла

$$R_s = r/eP_s \quad (1)$$

не зависит от напряженности магнитного поля $100 \leq H \leq 7000\text{ Э}$ и силы тока $10^{-6} \leq J \leq 10^{-3}\text{ А}$.

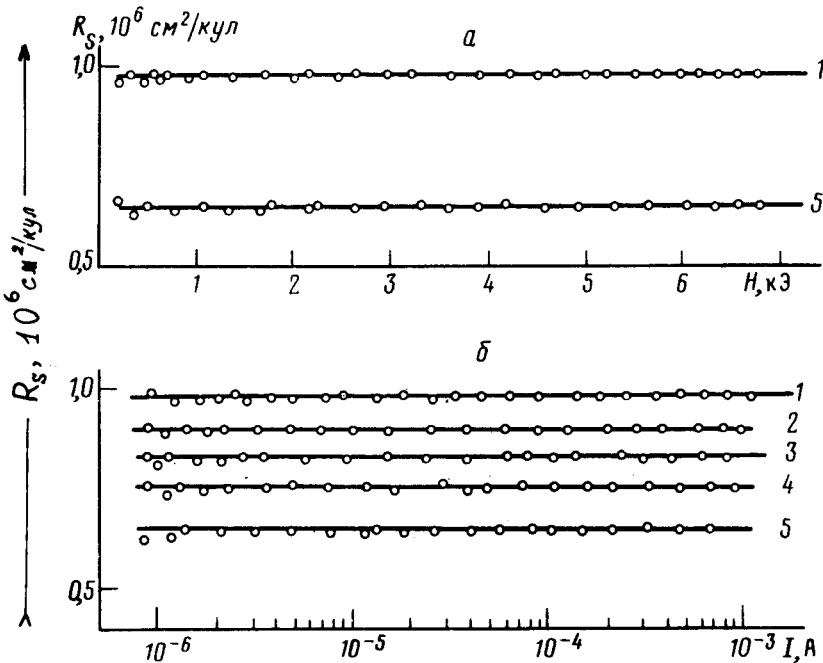


Рис. 1. Зависимость константы Холла: *a* – от напряженности магнитного поля при $I = \text{const} = 50\text{ мкА}$, *б* – от силы тока при $H = \text{const} = 2\text{ кЭ}$ (цифры на кривых соответствуют номерам образцов)

В наших условиях можно принять, что фактор Холла $r = 1$. Тогда концентрация дырок

$$P_s = (6 \div 10) \cdot 10^{12} \text{ см}^{-2},$$

как и на поверхности сращивания бикристаллов германия [2].

При столь больших концентрациях рассеяние дырок происходит, главным образом, на заряженных центрах. Расчет подвижности в этих условиях для двумерной модели дает, что [3]

$$\mu = \frac{\kappa h \sqrt{P_s}}{2 \sqrt{2 \pi e m^* N_i}} \left(\arctg \frac{\kappa h^2 P_s}{4 \pi e^2 m^* \sqrt{N_i}} \right)^{-1}, \quad (2)$$

где κ – диэлектрическая постоянная, h – постоянная Планка, e – заряд электрона, m^* – эффективная масса носителей, P_s – концентрация носителей, N_i – концентрация рассеивающих центров.

В первом приближении можно принять, что у поверхности германия, как и в объеме, $\kappa = 16$, эффективная масса дырок $m_h^* = 0,4 m_e$, а концентрация рассеивающих центров $N_i \approx P_s$. Тогда рассчитанные значения примерно в два раза меньше, чем измеренные холловские, что при грубых допущениях можно считать довольно удовлетворительным совпадением.

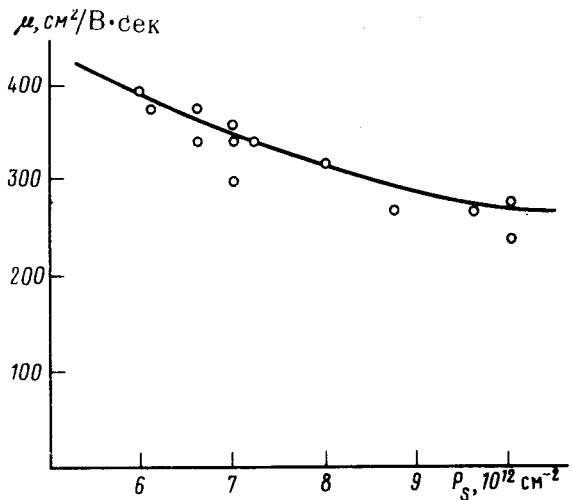


Рис. 2. ● – Зависимость подвижности дырок от их концентрации, — — — – удвоенное значение $\mu_{\text{теор}}$, рассчитанного согласно (2)

Непосредственно после раскола кристаллов в жидким гелием добавочная электропроводность, σ_s , вносимая свежеобразованной гладкой поверхностью, незаметна на фоне объемной проводимости. Промежуточный подогрев в парах гелия позволяет выявить влияние новообразованной поверхности.

При подогреве до $\sim 40\text{K}$ и выдержке в течение одной – двух минут поверхностная электропроводность, измеренная при $T = 4,2\text{K}$, достигает значений $\sigma_m \approx 4 \cdot 10^{-4} \Omega^{-1}$, и поверхностный ток при этом в $10^5 \div 10^6$ раз превышает объемный. Если промежуточный подогрев происходит при $T_n < 40\text{K}$ или недостаточно продолжителен, то поверхностная электропроводность σ_s не достигает значения σ_m , однако, возрастает по мере увеличения длительности подогрева. При хранении образцов в жидким

гелии эти промежуточные значения σ_s не изменяются в течение многих часов. Измерения эффекта Холла на поверхностях с электропроводностью

$$0,1 \sigma_m \leq \sigma_s \leq \sigma_m$$

позволили убедиться в том, что концентрация дырок при этом заметно не отличается от предельного значения P_m .

Таким образом, можно предположить, что рост поверхностной электропроводности с увеличением длительности промежуточного подогрева вызывается процессами, аналогичными отжигу дефектов, и сопровождается ростом подвижности носителей.

Предельное значение поверхностной электропроводности $\sigma_m \approx 4 \cdot 10^{-4} \text{ Ом}^{-1}$ определяется, как и в случае бикристаллов германия, движением дырок с концентрацией $P_s = (6 + 10) \cdot 10^{12} \text{ см}^{-2}$ и подвижностью $\mu = 400 \div 250 \text{ см}^2/\text{В}\cdot\text{сек.}$

Полученные данные позволяют считать, что общая физическая картина наблюдаемых нами явлений примерно та же, что и на поверхности сращивания бикристаллов германия [2]. В последнем случае, однако, не требуется промежуточный нагрев, так как процесс роста бикристалла происходит при температуре гораздо более высокой, чем T_n .

Электроны из велентной зоны германия захватываются на оборванные связи, которые возникают, в первом случае — при расколе кристалла, а во втором — в процессе роста кристалла на двойную затравку с большим углом наклона. Проводимость поверхности раскола кристалла, как и поверхности сращивания двух кристаллов в германии обусловлена движением вблизи поверхности дырок, которые остаются свободными вплоть до самых низких температур.

Авторы выражают благодарность инженеру Е.Г.Сокол за помощь в работе.

Физический институт им. П.Н.Лебедева
Академии наук СССР

Поступила в редакцию
20 декабря 1979 г.

Литература

- [1] Б.М.Вул, Э.И.Заварицкая, Е.Г.Сокол. Письма в ЖЭТФ, 30, 517, 1979.
- [2] Б.М.Вул, Э.И.Заварицкая. ЖЭТФ, 76, 109, 1979.
- [3] S.Kawaji, Y.Kawaguchi. Proc. Intern. Conf. Phys. Semicond, Kyoto p. 336, 1966.